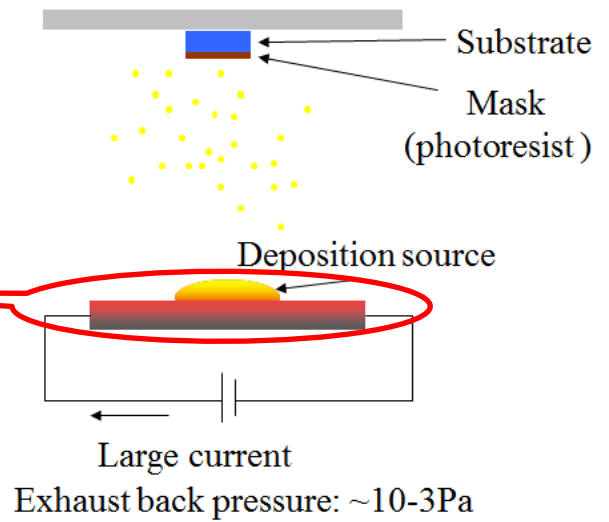
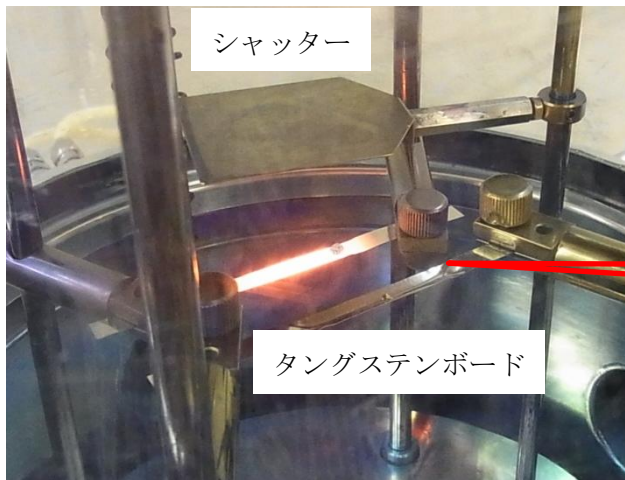
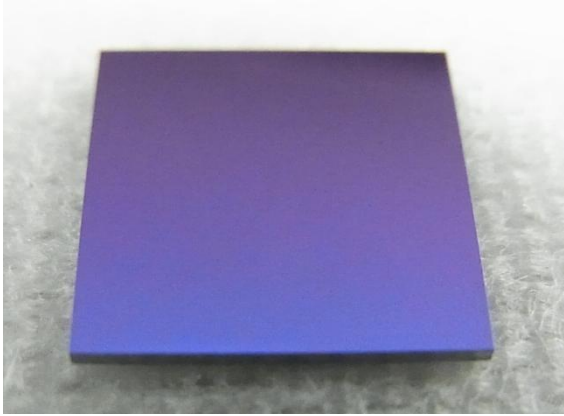


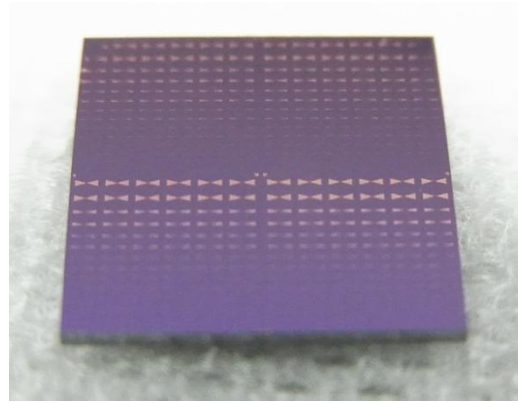
真空蒸着装置(SANYU SVC-700TURBO-TM)



- ・ 10^{-3} Pa 雰囲気ではタングステンボードに電流を流し、蒸着源を昇華させ、チャンバー内の上部に固定された基板に蒸着する。
- ・ 真空蒸着は膜厚の制御が容易である。チャンバー内のシャッターを開閉することで製膜時間を制御し、任意の膜厚を得ることができる。
- ・ 膜厚はチャンバー内にある膜厚計で測定することができる。



蒸着前の SiO₂ 基板表面像



蒸着後 SiO₂ 基板表面像

・ SiO₂ 基板上に Au を蒸着した。左図が蒸着前の基板表面像、右図が蒸着前の基板表面像となっている。右図のリボン型にパターニングされている部分に Au が蒸着されている。